ミニ・ガスクリーン・ハイフロー

中流量の半導体プロセスガス用
超コンパクトフィルター

“ミニ・ガスクリーン・ハイフロー”は、“ミニ・ガスクリーン”のコンパクトな構造そのままに、流量－圧力損失特性を大幅に向上させたインライン・ガスフィルターです．その小さな外形からは想像ができないほどの流量の処理が可能です。したがって、最小限のスペースで中流量の処理が可能になりました。より小さなスペースでの配管設計が要求される、半導体プロセスガスのラインでの使用に最適です。

特長

- 優れた流量－圧力損失特性
- 超コンパクトな外形
- 小さい内容積
- 全品完全性試験、耐圧、ヘリウムリーク試験済

利点

- 中流量（80 NL/min）まで処理が可能
- 最小限の設置スペースで装着可能
- 優れたガス置換特性
- 高い信頼性
- 速やかなドライダウン、ガス純度の維持

■材質

構成部品	材　質
フィルターメディア	PTFE
コア、エンドキャップ	PFA
フィルターハウジング	316Lステンレススチール（VAR）
O-リング	FEPカプセル・フッ素ゴム

■仕様

ろ過精度*1	≥ 3 nm*2
TR値（80 NL/min）	10^9
最高使用圧力（121℃）	1 MPaG未満*3
耐差圧（21℃）	0.55 MPa
耐逆圧（21℃）	0.34 MPa
ヘリウムリーク率 （atm・cc/sec）	＜1×10^{-9}（出荷前試験） 2×10^{-11}（設計値）
推奨流量	～ 80 NL/min

＊1　NaClエアロゾル試験による定格付け
＊2　CNCカウンター（TSI Model 3025）で計測した場合の検出限界値
＊3　本製品の設計圧力および製品上の表示は 1000PSI ＝ 6.9 MPaG、全品耐圧試験後出荷しています。ただし、本製品は高圧ガス取締法適合品ではありませんので、ガス用途に使用される場合、最高使用圧力は 1 MPaGとなります。高圧ガス取締法適合品に関しては、当社各営業所までお問い合わせください。
＊4　VCR継手の場合

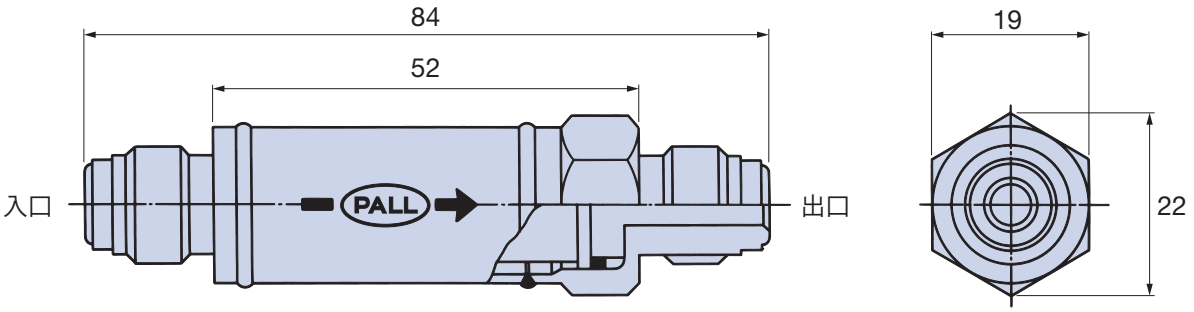
(注) ガスクリーンはポール社の登録商標です。(商標登録第2720960号)

ミニ・ガスクリーン・ハイフロー

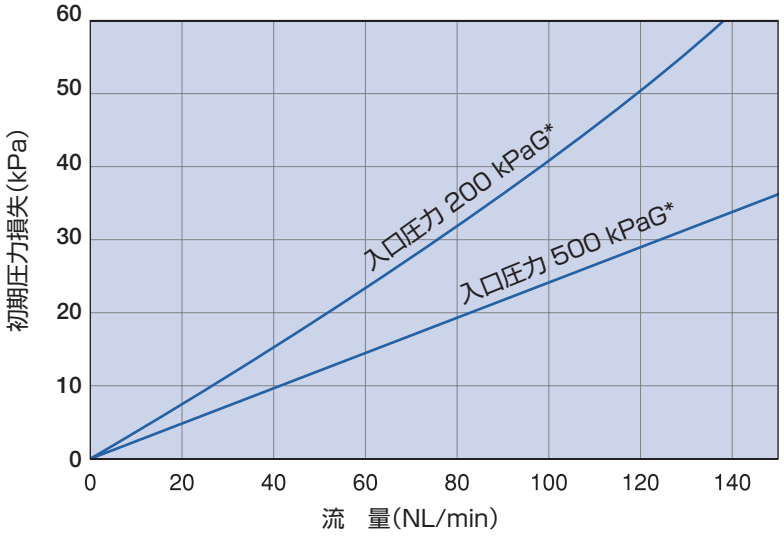
製品型式	継　　手	L寸法（mm）
GLFPF3101VMM4	1/4″ ガスケットシール、オス（VCR*5対応）	84
GLFPF3101SM4	1/4″ コンプレッションシール、オス（スウェージロック*5対応）	73
GLFPF3101VMF4	1/4″ ガスケットシール、一次側オス十二次側メス（VCR*5対応）	100

■外形図

GLFPF3101VMM4



■流量—圧力損失特性（室温の空気）



(*入口圧力)

PALL 日本ポール株式会社

マイクロエレクトロニクス事業部
〒163-1325　東京都新宿区西新宿6-5-1
TEL.03(6901)5700

本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性に付いては保証するものではありません。
本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。

2019/06改訂04V